

II. NEMZETKÖZI REPROGRÁFIAI KONGRESSZUSRÓL



Internationale
fachausstellung für
reprographie
Köln
25.-30. oktober 1967

A II. Nemzetközi Reprográfiai Kongresszus és a vele egyidőben megrendezésre kerülő kiállítást ismét Köln városában tartják meg 1967. október 25-31 között. Az 1963-ban tartott első kongresszus első ízben foglalta össze nagyszabású seregszemlén a reprográfiával foglalkozó kutatók eredményeit és az alkalmazott technikai ismereteket. Ennek eredményeként jelent meg Othmar HELWICH szerkesztésében a Reprographie* című tanulmánykötet, mely átfogó képet rajzolt a kongresszus munkájáról, ahol a következő kérdéscsoportokkal foglalkoztak behatóan:

A. A reprográfiai eljárások alapjai

1. a reprográfiai eljárások alapja és mechanizmusa
 - a., reprográfiai információelmélet
 - b., eziüstsós eljárások
 - c., elektrofotográfia
 - d., egyéb eljárások
2. alkalmazástechnikai problémák
 - a., készülékek tervezése
 - b., eljárások
 - c., fénytechnika és optika

B. A reprográfiai eljárások felhasználása

1. általános alkalmazástechnika
2. gyakorlati tapasztalatok különböző alkalmazási területeken
 - a., közigazgatás
 - b., gazdasági élet
 - c., kultúra, tudomány és kutatás
3. egyéb kérdések
 - a., oktatás a reprográfia területén
 - b., szerzői jog
 - c., hitelesség; hamisítások

*HELWICH, Othmar: Reprographie, Bericht über den I. Internationalen Kongress für Reprographie, Köln, 14-19. Oktober 1963. Darmstadt, 1964. XVI+397 p.

Az I. Nemzetközi Reprográfiai Kongresszust követően a közel 25 ország tagjaiból álló Nemzetközi Reprográfiai Állandó Bizottság kérésére a Deutsche Gesellschaft für Photographie és a Messe- und Ausstellungs- Gesellschaft újra Kölnben tartja meg a kongresszust. Ezen alkalmat ismét felhasználják arra, hogy ebben az időben olyan egyéb jelentős eseményekkel együtt rendezzék a kongresszust, mint pl. a Nemzetközi Reprográfiai Kiállítás; a Nyugatnémet Irodatechnikai Kiállítás; a Deutsche Gesellschaft für Photographie különkiállítása; a Nemzetközi Reprográfiai Állandó Bizottság ülése; a Deutsche Gesellschaft für Dokumentation "Reprographie" szakbizottságának ülése. Az október 25-31. között megrendezésre kerülő kongresszus előadássorozata is két főkérdés köré csoportosul. Az elméleti kérdések-témakör a különböző reprográfiai eljárások alapkérdéseivel, jelenlegi helyzetével, a távolabbi lehetőségekkel és további fejlesztési lehetőségekkel foglalkozik a következő felbontásban:

Elméleti kérdések:

1. a reprográfia elméleti alapjai
2. eljárások: a., ezüsthalogén
b., elektrofotográfia
c., egyéb
3. elméleti fejtegetések különféle berendezésekről (pl. optika, fénytechnika, stb.)

A másik témakör elsősorban a reprográfia széleskörű alkalmazási területének - mint pl. a közigazgatás, a gazdasági élet, a kultúra minden területe, a tudomány, műszaki élet és tudományos kutatás - kérdéseivel, jelenlegi helyzetével, kilátásaival foglalkozik a következő eljárások alkalmazása köré csoportosítva:

Alkalmazástechnikai kérdések

1. ezüsthalogén eljárások
2. diazoeljárások
3. elektrofotográfiai eljárások
4. mikrofilmtechnika

A kongresszus munkája mellett lehetőség nyílik arra, hogy egy kollokviumon találkozhassanak a résztvevők a tervezőmérnökökkel, a fotokémiában és az alkalmazástechnikában eredményt elért szakemberekkel.

A program a szervezőbizottság előzetes értesítője alapján ismét jelentős eseménynek ígérkezik. A hagyományos ezüsthalogén eljárások mellett számos téma foglalkozik az elektrosztatikus és egyéb eljárásokkal, bővebb teret kap a számítógépek alkalmazásával együtt használatos, katódcsővel működő mikrofilmes és elektrosztatikus gyorsíróberendezés. Számos előadás foglalkozik az irodatechnikában mind nagyobb teret hódító diazoeljárással működő másolás kérdéseivel, a mikromásolás legújabb problémáival, mint pl. a szabványosítás és a jogi kérdések. Mindezek azt mutatják, hogy a kongresszus mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban a legégetőbb problémák érintésével komoly feladatot vállalt magára. Ezért jogosan a szakemberek nagy várakozással tekintenek a kongresszus munkája elé.